

“表面粗さ”と“輪郭形状”の測定が検出器を交換するだけで得られます。
二次元表面粗さ測定機、三次元表面粗さ測定機、輪郭形状測定機を一体化した
多目的・多機能化した高精度型表面形状測定機です。

"Surface roughness" and "contour" measurement can be performed by
changing Pick Ups.
A multi-purpose surface roughness/contour measuring instrument.

表面粗さ測定

二次元粗さ測定

ISO、JIS、ASMEなど国際規格や各国新旧規格に対応した測定ができます
検出器の上下動から測定、印刷と一連の測定動作を実行できます

三次元粗さ測定

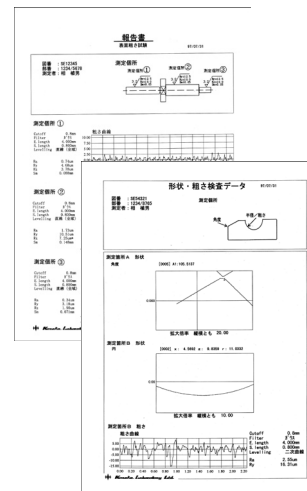
鳥瞰図は視点や天地を変えて記録できます。平面図は濃淡図や等高線図が得られます
最大1億ポイントのサンプリングなので、注目部をズームアップしても鮮明なデータが得られます

2D surface roughness measurement

The measurement meets international standard such as ISO, JIS, ASME etc.
Programable procedures such as movement of Driver, Pick up,
measurement and printing can be performed.

3D surface roughness measurement

The bird eye's view profile can be changed to other view points and recorded. Top view profile can be added.
Top view profile can change to contour line or differential contour figure.
Profiles may be zoomed up since sampling point is 100,000,000 (Max.)



SEF3500



SEF3500用輪郭形状検出器
Contour Pick-up for SEF3500

仕様

型 式		SEF3500/SEF3500K		SEF3500D/SEF3500DK		
一 次 元 粗 さ	測定パラメータ	Ra, Rz, Rt, Rp, Rv, RSm, Rq, Rsk, Rku, Rmr (c), Rmr, Rδc, RΔq, Rc, Ry, Rmax, Rpm, Rk, Rvk, Rpk, RmaxD, RzD, R3z Pa, Pz, Pt, Pp, Pv, PSm, Pq, Psk, Pku, Pmr (c), Pmr, Pδc, PΔq, Pc, PPI Wa, Wz, Wt, Wp, Wv, Wq, Wmr (c), WSm, WcA, WcM, Sm, S, tp, Htp, Δa, Δq, HSC, λa, λq, Mr1, Mr2,				
	測定範囲	縦:600μm 横:100mm サンプリング数/分解能:最大32,000点/16ビット				
	測定倍率	縦:50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000 横:1~5,000 (記録時は拡大縮小可能)				
	カットオフ値	粗さ	λc0.008, 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8.0mm, カットオフなし			
	うねり	λf0.8, 2.5, 8.0, 25.0mm fh0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm				
	フィルタ	ガウシアン, 2CR, 特殊ガウシアン				
	オートレベリング	全域、前半、後半、中心、2点、バラボラ、二次曲線補正、スプライン				
二 次 元 粗 さ	測定長さ	評価長さ方式 λc×1~×10 (3500K/3500DK:×1~×5) 基準長さ方式 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80mm及び任意長さ (0.2mm以上)				
	送り速さ	0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0mm/s 高速移動速度 10mm/s及び手動				
	主な機能	自由レイアウト記録、平均処理、統計処理、打ち切り測定、再演算、自動感度校正、自動測定、切り欠き処理、メートル/インチ				
	真直度測定精度	0.2μm/100mm				
	検出器	触針:R2μm ダイヤモンド 測定力0.75mN 頂角60° スキッド:R40mm サファイア				
	解析項目	平面図 :等高線図/微分濃淡図/標高表示図 鳥瞰図 (水平、俯角可変) :スキャン図/網掛図/等高線図/微分濃淡図 三次元解析 :SRp/SRv/SRmax/SRa/SGr/SSr/SRz/SRq/SRsk/SΔa/Sλa/Spc/標高 粒子解析 :山 (又は谷) 粒子の密度、平均面積、平均体積、平均直径 グラフ :FFT/BC				
	測定範囲	Z 600μm X 100mm Y 50mm				
	サンプリング数	最大1億点 (XY積) サンプリング最小間隔:1μm				
	測定精度	X:±0.1%/5mm Z:±0.2%/5mm		Z: (1+ 0.04h μm) ×: (1+0.02L) μm但し、h=Z変位mm、L=測定長さmm		
	測定範囲	縦:50mm 横:100mm		縦:58mm 横:100mm 縦/横分解能:0.05μm/0.1μm		
輪 郭 形 状	データ数	最大:64,000点		最大:130,000点		
	送り速さ	0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.2mm/s 高速移動速度 10mm/s及び手動				
	測定項目	要素解析:点、線、円、山、谷、交点、接点、/スカラー量:座標差、距離、交角、/ボールネジ解析、*非球面解析、*マスタ比較解析				
	真直度測定精度	1μm/100mm				
	検出器	R25μm 10~30mN 超硬 追従角度:登り77度/下り87度				
	設置寸法・重量	測定部:W600×D395×H593mm 80kg 演算部:W900×D600×H520mm 30kg				
電源電圧		単相AC90~120V 800VA 50/60Hz				

注意) *印はSEF3500/3500Kの場合オプションです。 黄色部仕様はSEF3500K/3500DKのみに可能です。